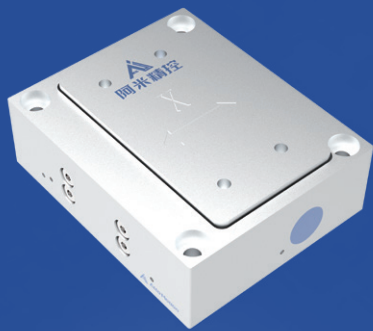




X轴纳米定位/扫描平台

产品特点：
X轴纳米定位/扫描平台基于微纳柔性机构和压电执行器实现超高分辨力纳米运动，内置电容位移传感器，通过高性能纳米伺服系统实现闭环控制，具有亚纳米级运动分辨率、纳米级运动精度和高速、高动态轨迹扫描功能。
支持面向不同应用和需求的产品开发与定制。

规格：

型号	NP-ST-X-100	
主动轴	X	
传感器类型	电容传感器	
驱动类型	压电陶瓷	
闭环行程	100	μm
最大负载	1	kg
分辨率	0.25	nm@50Hz
重复定位精度	1	nm
无负载谐振频率	3000	Hz
尺寸	55x45x18.3	mm
自重	208	g
电气接口	D-sub9	
材料	铝合金/钛合金	
真空度	超真空兼容5x10 ⁻⁹ (mbar)可选	
工作温度	-20-80	℃
推荐控制器/驱动器	数字伺服控制器NPC-031/纳米伺服控制器APS-203	

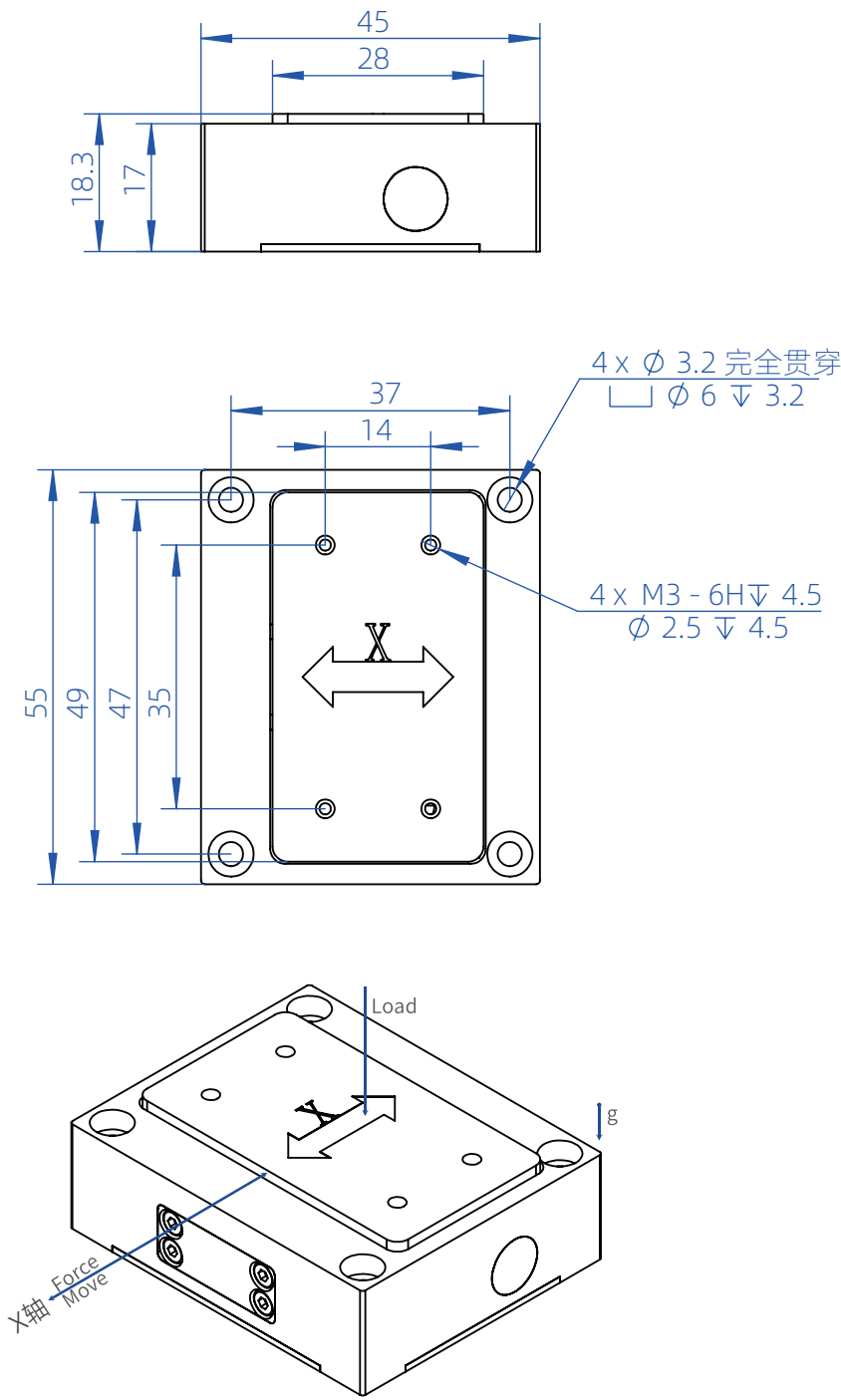
技术特点：

超高定位精度
高动态
多运动模式：定位/扫描
兼容超高真空
无摩擦柔性铰链导向

应用领域：

光学对准
纳米压印
显微成像/操纵
光栅刻写
双光子聚合
光学移相
晶圆检测
表面检测
测量技术
半导体加工

图纸: _____



尺寸: 毫米